

Studia I stopnia – I rok

Grupa Data	MTMX-121	IBAME-122 IBM-E	CIĄG A				CIĄG B		
			IP-121	IP-122	IP-123 MT-125	MT-121	MT-122	MT-123	MT-124
01.09	Ogólnouczelniany egzamin z JO (według zgłoszeń)								
02.09	EPH (sem. I) 8:15 – 11:00 r. 522	WELE (sem. II) 15 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ s. 133 (GE)							
03.09			MATEMATYKA I (sem. I) 8 ¹⁵ - 12 ⁰⁰ s. 6, 11, 16						
04.09	CALC2 9:00 AM r. AK, A1 (MEiL)								
05.09		MWM (sem. II) 11 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 16	MECHANIKA (sem. II) 11 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 6, 11						
06.09									
07.09									
08.09	ELC1 (sem. II) 9:15 – 11:00 r. 422								
09.09	MCN (sem. II) 9:15 – 12:00 r. 422	FIZ (sem. II) 14 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ s. 6 (GM)							
10.09	CALC2 9:00 - r. AK, A1 (MEiL)	ME (sem. I) 12 ¹⁵ – 16 ⁰⁰ s. 519	MATEMATYKA II (sem. II) 8 ¹⁵ - 12 ⁰⁰ s. 6, 11, 16						
11.09		ANAL2 (sem. II) 12 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ s. 161 (GE)							
12.09			ZASADY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO I (sem. I) 9 ¹⁵ - 12 ⁰⁰ s. 6, 11						
13.09									
14.09									
15.09			FIZYKA I (sem. II) 8 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 6, 11						

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2024/2025

STUDIA DZIENNE

Studia I stopnia – II rok

Grupa Data	MTMX-141	IBAME-141 IBM-I IBM-E	IP-141	IP-142	MT-141	MT-142	MT-143	MT-144
01.09	Ogólnouczelniany egzamin z JO (według zgłoszeń)							
02.09	MOS1 (sem. III) 9:15 – 11:00 r. 716	RAD (sem. III) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 336	MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (sem. III) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16					
03.09	BAC1 (sem. III) 9:15 – 11:00 r. 522	SEPO 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 716	PODSTAWY AUTOMATYKI I (sem. IV) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 6, 16					
04.09								
05.09	FMD2 (sem. IV) 9:15 - 11:00 r. 522	BIOME (sem. IV) 9 ¹⁵ - 12 ⁰⁰ s. 519	WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW (sem. III) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 6, 16					
06.09								
07.09								
08.09	CALC3 (sem. IV) 9:15-11:00 r. 716		ELEKTRONIKA II (sem. IV) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16					
09.09		POMED 10 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰ s. 162 (GE)	PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA II (sem. III) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16					
10.09			PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH II (sem. IV) 15 ¹⁵ - 17 ⁰⁰ s. 6, 16 (sala 16 do godz. 19 ⁰⁰)					
11.09	ELTR1 (sem. IV) 9:15-11:00 r. 16	POAUT (sem. III) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 519	PODSTAWY POMIARÓW WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH (sem. IV) 11 ¹⁵ - 13 ⁰⁰ s. 6, 16					
12.09			ELEKTROTECHNIKA I (sem. III) 12 ¹⁵ - 14 ⁰⁰ s. 6, 16					
13.09								
14.09								
15.09								

Studia I stopnia – III rok

[illegible]

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2024/2025

STUDIA DZIENNE

Studia I stopnia – IV rok

[illegible]

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2024/2025

STUDIA DZIENNE

Studia II stopnia – rok I

Grupa Data	MTUSM-211, MTUSM-221	IB000-211	IPS					
01.09		PSB (sem. I) 9 ¹⁵ – 12 ⁰⁰ s. 140	SMM (sem. II) 12 ¹⁵ – 14 ⁰⁰ s. 11					
02.09	ADMC (sem. 1) 9:15 -11:00 r. 244	RDTR (sem. II) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 336	MTD (sem. II) 10 ¹⁵ - 12 ⁰⁰ s. 140					
03.09			ZTS (sem. I) 12 ¹⁵ – 15 ⁰⁰ s. 11					
04.09		WDM (sem. III) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 519						
05.09	SMMD (sem. 1) 9:15 -11:00 r. 603	ZTPDM (sem. III) 9 ¹⁵ - 11 ⁰⁰ s. 137						
06.09								
07.09								
08.09			MEN (sem. I) 10 ¹⁵ – 12 ⁰⁰ s. 140					
09.09	ETAP (sem. 1) 11:15 -13:00 r. 244		SMC (sem. I) 9 ¹⁵ -11 ⁰⁰ s. 11					
10.09								
11.09		FIZ_IB (sem. III) 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 140						
12.09			TBN 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 206					
13.09								
14.09								
15.09		OFID 9 ¹⁵ – 11 ⁰⁰ s. 517						

Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2024/2025

STUDIA DZIENNE

Objaśnienia użytych skrótów:

AAG	- Algebra and Geometry	OFFM	- Optical full-field measurement
ABI	- Aparatura biomechaniczna	OFT	- Optical Fiber Technology
ADMC	- Advanced Microcontrollers	OI1	- Optyka instrumentalna I
AKE	- Aktuatoryka elektryczna	OMP	- Opto-numeryczne metody pomiaru
AKU	- Podstawy akustyki i elektroakustyki	OMS	- Optical microsystems
ANAL2	- Analiza 2	ONMT	- Opto-numerical Methods and Testing
AUJ	- Audyty jakości	OPTM	- Optomechatronics
AUP	- Automatyka przemysłowa	PA	- Podstawy automatyki
BEM	- Budowa i eksploatacja urządzeń mechatroniki	PMO	- Podstawy mikroskopii optycznej
BMINZ	- Biomechanika inżynierska	POMED	- Podstawy obrazowania medycznego
BOAC	- Basis of Automation and Control I	PPO	- Połowe pomiary optyczne
CALC1	- Calculus I	PRD	- Podstawy realizacji dźwięku
CALC2	- Calculus II	PSA	- Projektowanie systemów automatyki
CALC3	- Calculus III	PSB	- Przetwarzanie sygnałów biomedycznych
DAFO	- Diffraction and Fourier Optics	PSBD	- Podstawy systemów baz danych
DPP	- Diagnostyka procesów przemysłowych	PSF	- Projektowanie systemów funkcjonalnych
DTP	- Podstawy poligrafii i projektowania DTP	PTB	- Podstawy technik badań urządzeń precyzyjnych
EAMEB	- Elektroniczna aparatura medyczna	PTM	- Podstawy teorii mechanizmów
ELC1	- Electric Circuits	PTS	- Przetwarzanie sygnałów
ELCS1	- Electronics 1	PW1-TEŚ	- Przedmiot wariantowy 1 - "Technika światłowodowa i sensory"
ELE1	- Elektronika 1	RDTR	- Radioterapia
ENPH	- Engineering Physics	ROB	- Robotyka
EPM	- Elementy i podzespoły mechatroniczne	SAP	- Systemy automatyzacji produkcji
ETAP	- Experiments - Theory and Practice	SAU	- Systemy automatyki
EUM	- Eksploatacja urządzeń mechatronicznych	SBI	- Systemy Buisness Intelligence
FI2	- Fizyka 2	SEMD	- Sensors and Measuring devices
FIB	- Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej	SEPO	- Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych
FIZ	- Fizyka	SIPR	- Sterowanie i programowanie robotów
FLM1	- Fluid mechanics I	SIRDM	- Standardy i rejestracja danych multimedialnych
FMD2	- Fine Machine Design II	SIWP	- Systemy informatyczne w przemyśle
FOP	- Fundamentals of Photonics	SMC	- Systemy mechatroniczne
FOT	- Podstawy fotoniki	SMM	- Systemy mikroprocesorowe w mechatronice
IAAD	- Industrial automata and devices	SMMD	- Simulations and Models of Mechatronic Devices
IAP	- Inteligentna aparatura pomiarowa	SMPM	- Systemy pomiarowe
INOP	- Instrumental optics	SMPW	- Skaningowe metody pomiarów współrzędnościowych
IPR	- Image Processing and Recognition	SNER	- Serwonapędy elektryczne robotów
IPR	- Inżynieria oprogramowania	SPC	- Sterowanie procesów ciągłych
IUD	- Identyfikacja układów dynamicznych	SPD	- Sterowanie procesami dyskretnymi
KMG	- Komputerowe modelowanie geometryczne	SPWT	- Sensory i przetworniki wielkości termodynamicznych
LTC	- Laser Techniques	STM	- Sensory w technikach multimedialnych
MCN	- Mechanics	STUT	- Sterowanie urządzeń technologicznych
MCR	- Microcontrollers	TEL	- Technika laserowa
MCS	- Mechatronic Systems	TELM	- Systemy teledywidualne
MDR	- Mechatronic drives	TES	- Teoria sterowania
ME	- Metrologia	TEW	- Technika wizyjna
MEL	- Materiały elektroniczne	TINF	- Transmisja informacji
MEN	- Matematyka - Metody numeryczne	TLB	- Techniki laboratoryjne i badawcze
MEP	- Metrologia przemysłowa	TMM	- Theory of Machines and Mechanism
MNN	- Metody numeryczne	TOE	- Technologia obwodów elektronicznych
MNT	- Mikro/nanotechnika	TPW	- Teoria Pomiarów Współrzędnościowych
MNUE	- Mikro- i nanoukłady elektroniczne	TTV1	- Technika telewizyjna 1
MOP	- Medical Optics	UAP	- Urządzenia automatyzacji produkcji
MOS2	- Mechanics of Structures II	UIZE	- Układy i zespoły elektroniczne
MPUM	- Metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych	UMD1	- Urządzenia multimedialne - I
MRP	- Maszyny i roboty pomiarowe	UPSK	- Urządzenia peryferyjne systemów komputerowych
MSI	- Metody sztucznej inteligencji	WDM	- Wybrane działy matematyki
MSWBP	- Metody statystyczne w badaniach przemysłowych	WELE	- Wstęp do elektrotechniki
MSYP	- Modelowanie systemów pomiarowych	ZBR	- Zasady budowy robotów
MTD	- Matematyka dyskretna	ZPIN	- Zarządzanie projektem informatycznym
MTL	- Programowanie w systemie MatLab	ZSDO	- Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych
MTRL	- Metrology	ZTP	- Zaawansowane techniki programowania
MWM	- Mechanika i wytrzymałość materiałów	ZTPDM	- Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych
NEM	- Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych	ZTPTP	- Zaawansowane techniki pomiarowe w topografii powierzchni
NM1	- Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatroniki I	ZTS	- Zaawansowane techniki sterowania
NMOT	- Numerical Methods in Optical Techniques		
NNMT	- Nanometrologia / Nanometrology		
NSI	- Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji w robotyce mobilnej		
OFD	- Optyka fourierowska i dyfrakcyjna		